PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-035828

(43)Date of publication of application: 06.02.1996

(51)Int.CI.

G01B 15/00 G01C 3/06

(21)Application number: 06-172523

(22)Date of filing:

25.07.1994

(71)Applicant:

KOBE STEEL LTD

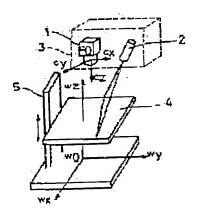
(72)Inventor:

SANO KO

NISHIKAWA KOHEI OKAMOTO AKIRA

(54) CALIBRATION METHOD OF THREE-DIMENSIONAL MEASURING APPARATUS

PURPOSE: To enable the generation of data for calibration in a short time with a simple structure by moving a plane having a plurality of lattice points with the positions thereof known vertically to photograph. CONSTITUTION: With a slit light source 2 turned OFF, a calibration target plane 4 set on a 1-axis stage 5 is positioned at two heights or more (at two WZ coordinates or more) to photograph a black circle (corresponding to a lattice) of a measuring pattern with a camera 1. A first parameter is calculated by an image processing. Then, with the light source 2 turned ON, the target plane 4 is positioned at two heights or more (more than two WZ coordinates) to photograph a slit light (light cutting line) on the target plane 4 with the camera 1. A photographing data is converted to a coordinate system of a taken surface using the first parameter and a second parameter is computed to define a projection surface of the slit light based on the conversion data.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-35828

(43) 公開日 平成8年(1996) 2月6日

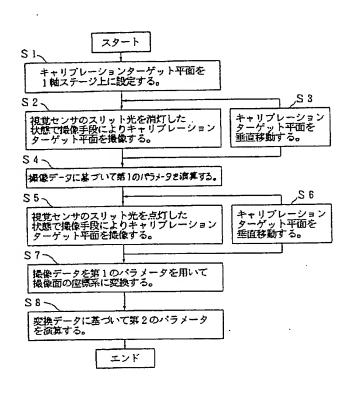
(51) Int.Cl. ⁶ G 0 1 B 15/00 G 0 1 C 3/06	設別記号 庁内整理番号 A A	FΙ	技術表示箇所
		審査請求	未請求 請求項の数3 OL (全 11 頁)
(21)出願番号	特願平6-172523	(71)出願人	000001199 株式会社神戸製鋼所
(22)出顧日	平成6年(1994)7月25日	(72)発明者	兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号 佐野 香 兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号 株式会社神戸製鋼所神戸総合技術研究所内
		(72)発明者	西川 晃平 兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号 株式会社神戸製鋼所神戸総合技術研究所内
		(72)発明者	岡本 陽 兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号 株式会社神戸製鋼所神戸総合技術研究所内
		(74)代理人	弁理士 本庄 武男

(54) 【発明の名称】 3次元計測装置のキャリプレーション方法

(57)【要約】

【目的】 比較的簡単な装置構成で、比較的短時間にキャリブレーションデータを得ることのできる3次元計測 装置のキャリブレーション方法。

【構成】 本方法は、3次元空間に配置され、かつ位置が既知である複数の格子点を有するキャリブレの事直方向に少なくとも1回移動前後で上記平面を2次元の画像面を有する撮像により撮像し(S1~S3)、撮像データに基づな長期の座標系と最像面の座標系との変換スラメータを演算した後(S4)、を上記平面に照射した後(S4)、とを撮り返し(S5、S6)、繰り返し時にお撮像面のツラメータを上記平の投光面を呈示する第2のパラメータを撮いて上記撮像面のツラメータを上記第1のパラメータを用いて上記撮像面のツラスに変換し(S7)、繰り返し時にお撮像面のツラスに変換し(S7)、変換データに表し、57)、変換データを用いて上記撮像面のツラスに変換し(S7)、変換データを用いて上記撮像面のツラスに変換し(S7)、変換データを用いて表し、50的できる。上記構成によりできる。とができることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光切断式視覚センサ系を具備した3次元 計測装置のキャリブレーション方法において,3次元空 間に配置され,かつ位置が既知である複数の格子点を有 する平面を該平面に垂直方向に少なくとも1回移動さ せ,該移動前後の上記平面を上記センサ系に含まれる2 次元の撮像面を有する撮像手段により撮像し,該撮像データに基づいて上記3次元空間の座標系と上記撮像面の 座標系との変換係数である第1のパラメータを演算する ことを特徴とする3次元計測装置のキャリブレーション 方法。

光切断式視覚センサ系を具備した3次元 【請求項2】 計測装置のキャリブレーション方法において, 3次元空 間に配置され,かつ位置が既知である複数の格子点を有 する平面を該平面に垂直方向に少なくとも1回移動さ せ, 該移動前後の上記平面を上記センサ系に含まれる2 次元の撮像面を有する撮像手段により撮像し、該撮像デ 一タに基づいて上記3次元空間の座標系と上記撮像面の 座標系との変換係数である第1のパラメータを演算した 後,上記センサ系に含まれる光源よりスリット光を上記 平面に照射しつつ,上記移動と撮像とをもう1度繰り返 し、該繰り返し時における撮像データを上記第1のパラ メータを用いて上記撮像面の座標系に変換し、該変換デ -タに基づいて上記スリット光の投光面を定義する第2 のパラメータを演算することを特徴とする3次元計測装 置のキャリブレーション方法。

【請求項3】 光切断式視覚センサ系を具備した3次元 計測装置のキャリブレーション方法において, 3 次元空 間に配置され,かつ位置と大きさとが既知である複数の 格子点を有する平面を該平面に垂直方向に少なくとも1 回移動させ,該移動前後の上記平面を上記センサ系に含 まれる2次元の撮像面を有する撮像手段により撮像して メモリ内に記憶し、上記センサ系に含まれる光源により スリット光を上記平面に照射しつつ,上記撮像手段によ り撮像したときに該撮像画面上でスリット光がある2つ の格子点間を内分する点Pの位置及び該内分の比率を演 算し,上記メモリ内に記憶された平面上の上記点Pに対 応する点P′の位置を上記比率を用いて演算し,上記2 つの点P,P′の位置の座標の組からなるキャリブレー ションデータを用いて上記3次元空間の座標系と上記メ モリ内の座標系との変換係数である第3のパラメータを 演算してなることを特徴とする3次元計測装置のキャリ ブレーション方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、3次元計測装置のキャリブレーション方法に係り、詳しくは光切断式視覚センサ系を具備した3次元計測装置のキャリブレーション方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】光切断式視覚センサにより,物体の3次 元位置等を精度よく計測するためには、光切断式視覚セ ンサのカメラパラメータ及びスリット光などの光切断平 面方程式であるプロジェクタパラメータを正確に求めて おくことが必要である。このため、従来は図9に示すよ うに,予め定める平面上にある被検出点をXYZテーブ ル上で移動して, X _c , Y _c 軸を有する撮像面を有する 撮像手段で少なくとも6点を撮像し、XYZテーブルの 座標系と撮像手段の座標系との変換係数即ちカメラパラ メータをまず求める。しかる後、被検出点をXYZテー ブル上でのスリット光の前記平面上の輝線に交差する直 線方向に移動して,撮像手段によって撮像し,前記平面 上の被検出点のたどる直線と,撮像面での被検出点の像 がたどる曲線との関係を少なくとも3枚以上の前記平面 毎に求めることにより,スリット光の平面の方程式を求 め、キャリブレーションを行っている(特開平2-27 1206号公報参照)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記したような従来の 3次元計測装置のキャリブレーション方法では, カメラ パラメータやプロジェクタパラメータを求める際, 1つのキャリブレーションデータを作成するために, 被検要 ある。このため, キャリブレーションデータ作成に簡単が必要である。このため, キャリブレーションが必要である。 このため, キャリブレーションが必要である。 本発明は, このような従来の技術における課題であった。 本発明は, このような従来の技術における課題を改良し, 比較的簡単な装置構成でキャリブレーション方法を提供することを目的とするものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に第1の発明は、光切断式視覚センサ系を具備した3次 元計測装置のキャリブレーション方法において, 3 次元 空間に配置され,かつ位置が既知である複数の格子点を 有する平面を該平面に垂直方向に少なくとも1回移動さ せ、該移動前後の上記平面を上記センサ系に含まれる2 次元の撮像面を有する撮像手段により撮像し、該撮像デ ータに基づいて上記3次元空間の座標系と上記撮像面の 座標系との変換係数である第1のパラメータを演算する ことを特徴とする3次元計測装置のキャリブレーション 方法として構成されている。第2の発明は、光切断式視 覚センサ系を具備した3次元計測装置のキャリブレーシ ョン方法において,3次元空間に配置され,かつ位置が 既知である複数の格子点を有する平面を該平面に垂直方 向に少なくとも 1 回移動させ,該移動前後の上記平面を 上記センサ系に含まれる2次元の撮像面を有する撮像手 段により撮像し、該撮像データに基づいて上記3次元空 間の座標系と上記撮像面の座標系との変換係数である第

1のパラメータを演算した後、上記センサ系に含まれる 光源よりスリット光を上記平面に照射しつつ,上記移動 と提像とをもう1度繰り返し、該繰り返し時における撮 像データを上記第1のパラメータを用いて上記撮像面の 座標系に変換し、該変換データに基づいて上記スリット 光の投光面を定義する第2のパラメータを演算すること を特徴とする3次元計測装置のキャリブレーション方法 である。第3の発明は、光切断式視覚センサ系を具備し た3次元計測装置のキャリブレーション方法において, 3次元空間に配置され、かつ位置と大きさとが既知であ る複数の格子点を有する平面を該平面に垂直方向に少な くとも1回移動させ、該移動前後の上記平面を上記セン サ系に含まれる2次元の撮像面を有する撮像手段により **撮像してメモリ内に記憶し、上記センサ系に含まれる光** 源によりスリット光を上記平面に照射しつつ、上記撮像 手段により撮像したときに該撮像画面上でスリット光が ある2つの格子点間を内分する点Pの位置及び該内分の 比率を演算し、上記メモリ内に記憶された平面上の上記 点Pに対応する点P′の位置を上記比率を用いて演算 し、上記2つの点P, P'の位置の座標の組からなるキ ャリブレーションデータを用いて上記3次元空間の座標 系と上記メモリ内の座標系との変換係数である第3のパ ラメータを演算してなることを特徴とする3次元計測装 置のキャリブレーション方法である。

[0005]

【作用】光切断式視覚センサ系を具備した3次元計測装 置のキャリブレーションに際し、3次元空間に配備さ れ、かつ位置が既知である複数の格子点を有する平面が 該平面に垂直方向に少なくとも1回移動させられる。該 移動の前後の上記平面が上記センサ系に含まれる2次元 の撮像面を有する撮像手段により撮像される。該撮像デ 一タに基づいて上記3次元空間の座標系と上記撮像面の 座標系との変換係数である第1のパラメータが演算され る。このように、比較的簡単な装置構成でカメラパラメ 一タを含む第1のパラメータを容易に得ることができ る。第2の発明によれば、上記第1の発明により第1の パラメータが演算された後、上記センサ系に含まれる光 源よりスリット光が上記平面に照射されつつ、上記移動 と撮像とがもう1度繰り返される。該繰り返し時に撮像 データが上記第1のパラメータを用いて上記撮像面の座 標系に変換される。該変換データに基づいて上記スリッ ト光の投光面を定義する第2のパラメータが演算され る。このように比較的簡単な装置構成でプロジェクタパ ラメータである第2のパラメータをも得ることができ る。第3の発明によれば、光切断式視覚センサ系を具備 した3次元計測装置のキャリブレーションに際し、3次 元空間に配置され、かつ位置と大きさとが既知である複 数の格子点を有する平面が該平面に垂直方向に少なくと も1回移動させられる。該移動前後の上記平面が上記セ ンサ系に含まれる2次元の撮像面を有する撮像手段によ

り撮像されメモリ内に記憶される。上記センサ系に含ま れる光源によりスリット光が上記平面に照射されつつ。 上記撮像手段により撮像された時に該撮像画面上でスリ ット光が, ある2つの格子点を内分する点 Pの位置及び 該内分の比率が演算される。上記メモリ内に記憶された 平面上の上記点 Pに対応する点 P'の位置が上記比率を 用いて演算される。上記2つの点P、P′の位置の座標 の組からなるキャリブレーションデータを用いて、上記 3次元空間の座標系と上記メモリ内の座標系との変換係 数である第3のパラメータが演算される。このように比 較的簡単な装置構成でカメラパラメータ及びプロジェク タパラメータを含む第3のパラメータを得ることができ る。その結果、いずれの場合も比較的簡単な装置構成 で、各パラメータ求める際のキャリブレーション用デー タを比較的短時間に作成することができる。

[0006]

【実施例】以下添付図面を参照して、本発明を具体化し た実施例につき説明し、本発明の理解に供する。尚、以 下の実施例は、本発明を具体化した一例であって、本発 明の技術的範囲を限定する性格のものではない。ここ に、図1は第1、第2の発明の一実施例(第1、第2の 実施例)に係る3次元計測装置のキャリブレーション方 法の概略構成を示すフロ一図、図2は上記第1,第2の 実施例に係るキャリブレーション方法を適用可能な装置 の概略構成を示す模式図,図3は上記第1,第2の実施 例に係るキャリブレーションターゲット平面を示す例 図,図4は上記第1,第2の実施例に係るキャリブレー ション方法の基本原理を示す説明図、図5は第3の発明 の一実施例(第3の実施例)に係る3次元計測装置のキ ャリブレーション方法の概略構成を示すフロ一図、図6 は上記第3の実施例に係るキャリブレーション方法の詳 細フロ一図、図7は上記第3の実施例に係るキャリブレ ―ションターゲットを示す例図、図8は上記第3の実施 例に係るキャリブレーション方法の基本原理を示す説明 図である。図1に示すごとく、第1の発明の一実施例 (第1の実施例)に係る3次元計測装置のキャリブレー ション方法は、光切断式センサ系を具備した3次元計測 装置のキャリブレーション方法である点で従来例と同様 である。しかし、本第1の実施例では、3次元空間に配 置され、かつ位置が既知である複数の格子点を有する平 面を該平面に垂直方向に少なくとも1回移動させ,該移 動前後の上記平面を上記センサ系に含まれる2次元の撮 像面を有する撮像手段により撮像し(S1~S3),該 撮像データに基づいて上記3次元空間の座標系と上記撮 像面との変換係数である第1のパラメータを演算する (S4) 点で従来例と異なる。また第2の発明の一実施 リブレーション方法のステップS1~S4の後、上記セ ンサ系に含まれる光源によりスリット光を上記平面に照

例(第2の実施例)では、上記第1の実施例に係るキャ 射しつつ,上記移動と撮像とをもう1度繰り返し(S

5, S6), 該繰り返し時における撮像データを上記第 1のパラメータを用いて上記撮像面の座標系に変換し (S7), 該変換データに基づいて上記スリット光の投 光面を定義する第2のパラメータを演算する(S8)点 で従来例と異なる。

【0007】図2は上記第1,第2の実施例に係るキャ リブレーション方法に適用可能な装置の概略構成を示 す。図中,センサヘッド3にはCCDカメラ等の撮像装 置1(撮像手段に相当)及びスリット光源2(光源に相 当)が内蔵されている。センサヘッド3の下方には、キ ャリブレーションターゲット平面4(平面に相当)を設 置した1軸ステージ5が置かれている。ここでは、キャ リブレーションターゲット平面4は1軸ステージ5の移 動方向に対し、直角方向に設置されている。キャリブレ ーションターゲット平面4上に設ける第1,第2のパラ メータ算出用の測定パターンであるキャリブレーション ターゲットの呈示例を図3に示す。以下、まず第1の実 施例に係るキャリブレーション方法の基本原理について 説明する。本方法では、第1のパラメータ算出の際に、 従来例におけるような3軸ステージではなく, 1軸ステ 一ジを用いる。ここで、図2に示すように、撮像装置1 にカメラ座標系co-cxcyczを設定すると共に、 1軸ステージ5にワーク座標系Wo-WxWyWzを設 定する。カメラパラメータを算出する手法に関しては,

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_a \end{bmatrix} = \text{Trans}(1_x, 1_y, 1_z) \text{ Rot}(Z_w, \alpha) \text{ Rot}(Y_w, \beta) \text{ Rot}(X_w, \gamma) \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \cdots (1)$$

【数1】

次に、第2の実施例に係るキャリブレーション方法の基 本原理について説明する。本第2の実施例では、上記第 1の実施例により第1のパラメータを求めた後第2のパ ラメータを算出するが、この場合にも図2に示すような 1 軸ステージ5を用いる。まずスリット光源2を点灯さ せた状態で1軸ステージ5上に設置したキャリブレーシ ョンターゲット平面4を2か所以上の高さ(2箇所以上 のw z座標)に位置決めして、撮像装置1によりキャリ ブレーションターゲット平面4上に投光されたスリット 光(光切断線)を撮像する。このとき、キャリブレーシ ョンターゲット平面4上の2か所以上の位置決め高さ(w_{Z_i} ; $i = 1 \sim n$) をも同時に図示しないメモリに記 憶しておく。このキャリブレーションターゲット平面 4 (A;;i=1~n)の位置決め高さ(w z;;i=1 ~n)はワーク座標系(Wo-W xW yW z)にて表現 される(図4参照)。

【0009】図4において,撮像面上の光切断線上の中心線は,画像処理により求めることができるが,光切断線像の中心線上の6 p, c q, c r, c s はカメラ座標系における座標位置として検出される。これらの6 p, c q, c r, c s, …のカメラ座標系における各座標置を用いて図4におけるスリット光平面の方程式を算

すでに日本ロボット学会誌 Vol. 10, No. 2, pp177~184等に示されているが、ここではその手法を応用する。図2の装置により第1のパラメータを集出するためにキャリブレーションデータを作成するには、まずスリット光源2を消灯した状態で、1軸ステージ5上に設置したキャリブレーションターゲットで面で2か所以上の高さ(2か所以上のwz座標に)位を2か所以上の高さ(2か所以上のwz座標に)位別第1のパラメータ算出用測定パターンを撮像する。そして、画像処理により、各撮影画像内の黒い円(格子に相当)の中心を撮像すると共に、1軸ステージ5上に設置した実際の第1のパラメータ第出用測定パターンの黒い円の中心座標をワーク座標系で求める。

【0008】このようにして、撮影画像内の黒い円の中心データと、ワーク座標系における第1のパラメータ算出用測定パターンの黒い円の中心座標が求まると、カメラパラメータに加えて、カメラ座標系とワーク座標系とで見係づける回転、平行移動を表す座標変換パラメータを求めることができる。上記カメラパラメータ及び座標変換パラメータが第1のパラメータに相当する。以上のようにカメラ座標系とワーク座標系とを関係づける座標変換パラメータが求まると、ワーク座標系からカメラ座標系への座標変換式は次式で表すことができる。

出するには、カメラ座標系において視線位置ベクトルC ocp,cocq,cocr,cocs,…を延長した 各直線がカメラ座標系により表現されたキャリブレーシ ョンターゲット平面 A₁ や A_i と交わる点 CP, CQ, c R, c S, …を求めればよい。しかし、この時点では キャリブレーションターゲット平面 A₁ , A_i はワーク 座標系にて表現されているため、このままではカメラ座 標系で表された視線位置ベクトルと,ワーク座標系で表 されたキャリブレーションターゲット平面A1, A; と の交点を計算できない。しかるに前述したごとく,カメ ラパラメータ算出の結果より、カメラ座標系とワーク座 標系とを関係づける座標変換式(1)式がすでに求めら れているので,この(1)式を用いてワーク座標系で表 されているキャリブレーションターゲット平面A1, A ; をカメラ座標系にカメラ変換することにより, カメラ 座標系におけるスリット面上の点c P, c Q, c R, c S, …を算出することが可能となる。この結果, カメラ 座標系におけるスリット光平面の方程式であるプロジェ クタパラメータは算出されたスリット面上の点CP,C Q, CR, CS, …の座標値を用いて最小2乗法により 算出できる。上記プロジェクタパラメータが第2のパラ メータに相当する。

【〇〇10】以上のように本第1の実施例では、光切断 式視覚センサのカメラパラメータを含む第1のパラメー タを、また第2の実施例ではさらにプロジェクタパラメ ータである第2のパラメータを1軸ステージを用いて容 易求めることができる。従っていずれの実施例において も、キャリブレーションに要する時間が短縮できると共 に、キャリブレーションステージの軸数を従来例よりも 減少させることができる。上記第1,第2の実施例で は、第1のパラメータと第2のパラメータとを別々に算 出したが、これらのパラメータを一体として算出するこ とによりさらに効率的にキャリブレーションデータを得 ることができる。第3の発明はこの点に着目したもので あり、以下述べる。図5に示すごとく、第3の発明の一 実施例(第3の実施例)に係る3次元計測装置のキャリ ブレーション方法は、光切断式視覚センサ系を具備した 3次元計測装置のキャリブレーション方法である点で従 来例と同様である。しかし、本第3の実施例では、3次 元空間に配置され、かつ位置と大きさとが既知である複 数の格子点を有する平面を該平面に垂直方向に少なくと も1回移動させ,該移動前後の上記平面を上記センサ系 に含まれる2次元の撮像面を有する撮像手段により撮像 して(S11~S13),メモリ内に記憶し(S1 4), 上記センサ系に含まれる光源によりスリット光を 上記平面に照射しつつ、上記撮像手段により撮像したと きに (S15, S16), 該撮像画面上でスリット光 が、ある2つの光視点間を内分する点Pの位置及び該内 分の比率を演算し(S17),上記メモリ内に記憶され た平面上の上記点 Pに対応する点 P'の位置を上記比率 を用いて演算し (S18), 上記2つの点P, P'の位 置の座標の組からなるキャリブレーションデータを用い て,上記3次元空間の座標系と上記メモリ内の座標系と の変換係数である第3のパラメータを演算する(S1 9)点で従来例と異なる。

【0011】本第3の実施例に係るキャリブレーション方法の詳細フローを図6にしめすが、ここにおいても、上記第1、第2の実施例と同様の装置を用いることがで

 $m:n = \sqrt{(x1-u)^2 + \{\varepsilon(y1-v)\}^2} : \sqrt{(x2-u)^2 + \{\varepsilon(y2-v)\}^2}$

ここで、 ε はアスペクト比である。被検出点 Pは、キャリブレーションターゲット平面 4において、同様の比率でキャリブレーションターゲット T 1、 T 2 間を内分する。キャリブレーションターゲット T 1、 T 2 は T 2、 T 3、 T 2 (T 4、 T 4、 T 5 は T 7、 T 8 にあるので、被検出点 T 7のようになる。 【数 3】

きる。この場合は、キャリブレーションターゲット平面 4には、予め位置と大きさとが既知であるキャリブレー ションターゲットが呈示されている。キャリブレーショ ンターゲット平面4上におけるキャリブレーションター ゲットの呈示のしかたは、例えば、図7に示すように座 標軸にあたる位置には、大きめのキャリブレーションタ ーゲットを用い、それ以外は小さめのキャリブレーショ ンターゲットを用いる。これらのキャリブレーションタ ーゲットの重心を結ぶと格子状になるようにキャリブレ ーションターゲットの位置を設定し、キャリブレーショ ンターゲット平面 4上での座標系を設定する。このた め、キャリブレーションターゲット平面4を2次元の撮 像面を有する撮像装置1(撮像手段に相当)で撮像した 際,画像信号が格納されたフレームバッファ(メモリに 相当) におけるそれぞれのキャリブレーションターゲッ トが、キャリブレーションターゲット平面4においてど のキャリブレーションターゲットであるかが明白とな る。また、フレームバッファにおいて、キャリブレーシ ョンターゲットの重心を求めると格子点となるが、この 格子点にばらつきがある場合は、最小2乗法を用いてキ ャリブレーションターゲットの重心を求める。以下、こ の方法における基本原理を説明する。まず、図8(a) に示すように、スリット光をキャリブレーションターゲ ット平面4に照射し、2次元の撮像面を有する撮像手段 1により撮像する。フレームパッファにおいて、キャリ ブレーションターゲット平面4は、図8(b)のように 格納されている。被計測点としてスリット光が, ある2 つのキャリブレーションターゲット間を内分する点Pを 用いる。被検出点Pが2つのキャリブレーションターゲ ットT1, T2間を内分する比m:nは,フレームパッ ファ上における被検出点Pの座標P′(u, v), 2つ のキャリブレーションターゲットの重心をT´ 1 (x) 1, y 1), T'2(x 2, y 2)を用いると次式とな

【0012】 【数2】

る。

$$\begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \end{bmatrix} = \frac{m}{m+n} \begin{bmatrix} tx2 - tx1 \\ ty2 - ty1 \\ tz2 - tz1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} tx1 \\ ty1 \\ tz1 \end{bmatrix}$$

このようにして得られた(x_W , y_W , z_W , u, v) をキャリブレーションデータとして用いる。ここで,図8(c)に示すように,センサ座標系(x_C , y_C , z_C) から撮像面座標系(x_D , y_D , 1) への透視変換,フレームバッファ座標系(u, v) から撮像面座標系(x_D , y_D) への変換,センサ座標系(x_C , y_C , z_C) からワーク座標系(x_W , y_W , z_W)への変換は,ワーク座標系とセンサの座標系との交換係数

 $(1_X, 1_Y, 1_Z, \alpha, \beta, \gamma)$, センサ座標系から 撮像面座標系への透視変換の係数 h, フレームパッファ 座標系から撮像面座標系へのアフィン変換の係数 (S_X, S_Y, u_0, v_0) を用いて次式で表すことが できる。

[0013]

【数4】

$$\begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_x & 0 & u_0 \\ 0 & S_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \end{bmatrix} = Trans(l_x, l_y, l_z)Rot(Z_c, \alpha)Rot(Y_c, \beta)Rot(X_c, \gamma) \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix}$$

また,スリット光の平面の方程式は次式表すことができ

 $a \times c + b \times c + z = d$

ここで、 $(h, S_x, S_y, u_0, v_0, l_x, l_y, l_z, \alpha, \beta, \gamma)$ はカメラパラメータであり、 (a, b, d) はスリット光のプロジェクタパラメータである。上記(2)、 (5) 式よりhは次式となる。

【数6】

$$h = \frac{d}{ax_p + by_p + f}$$

上記(2), (3), (4), (6) 式より, フレーム バッファ座標系から, ワーク座標系への変換は次式で表 すことができる。

【数7】

$$\begin{bmatrix} x_{w} \\ y_{w} \\ z_{w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{x}(u, v, p_{1}, p_{2}, \cdots, p_{13}) \\ F_{y}(u, v, p_{1}, p_{2}, \cdots, p_{13}) \\ F_{z}(u, v, p_{1}, p_{2}, \cdots, p_{13}) \end{bmatrix}$$

. ここで, fはカメラの焦点距離であり定数である。 【数5】

る。

... (5)

【0014】ここで、p11 ~p13はセンサパラメータ (1χ , 1y, 1_z , α , β , γ , S_x , S_y , a, b, d, u_0 , v_0) である。これらの値は公称値と公子を与えられるが、公差や設置条件により多少の誤差が生する。精度よく計測するためには、これらの誤差を求める必要がある。そこで、センサパラメータを(xw, yw, zw, u, v) を用いて求める。1点のデータをのデータをので、13個の未知数を解て、3つの方程式ができるので、13個の未知数を解て、3次元のキャリブレーションを行うためには、少なくとも5点のデータを必要とする。従って、3次元のキャリブレーションを行うために、3次元のキャリブレーションを行うためには、3次元のキャリブレーションを行列を用いたキャリブレーション計算のために、以下の量を提示する。

【数8】

$$F(u,v;p_{1},\cdots,p_{13}) = \begin{bmatrix} F_{x}(u,v;p_{1},\cdots,p_{13}) \\ F_{y}(u,v;p_{1},\cdots,p_{13}) \\ F_{y}(u,v;p_{1},\cdots,p_{13}) \end{bmatrix}$$

$$J_{p} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_{x}}{\partial p_{1}} & \cdots & \frac{\partial F_{x}}{\partial p_{13}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_{z}}{\partial p_{1}} & \cdots & \frac{\partial F_{z}}{\partial p_{13}} \end{bmatrix}$$

$$X_{pi} = \begin{bmatrix} X_{wi} \\ Y_{wi} \\ Z_{wi} \end{bmatrix}$$

$$p_{pi} = \begin{bmatrix} p_{p1i}, p_{p2i} & \cdots & p_{p12i}, p_{p13i} \end{bmatrix}^{T}$$

$$X_{D} = \begin{bmatrix} X_{p1} \\ \vdots \\ X_{pN} \end{bmatrix} \qquad (5 \le N)$$

$$X_{M} = \begin{bmatrix} F(u_{1},v_{1};p_{p1}) \\ \vdots \\ F(u_{N},v_{N};p_{pN}) \end{bmatrix}$$

$$J_{p}(u_{1},v_{1};p_{p1})$$

$$J_{p}(u_{1},v_{1};p_{p1}) \qquad (5 \le N)$$

$$J_{p}(u_{N},v_{N};p_{pN})$$

キャリブレーションアルゴリズムは以下のように示す反 復解法を用いる。

(ステップ1)収束判定条件 ε と初期値 p_0 を与え、 p_0 ← p_0 とする。

 $(X + y)^2 = X_M - X_D$

if $|\Delta X| \leq \varepsilon$ then end

(ステップ3) $\Delta X = J_M \Delta p_p$ より $\Delta p_p = J_M + \Delta X$ (ここで、 $J_M + lt$ 擬似逆行列)

 $(\lambda \tau \gamma \gamma^2 + \lambda \rho_p = \rho_p + \Delta \rho_p \quad \text{goto} \quad (\lambda \tau \gamma \gamma^2)$

【0015】このようにして、上記撮像面上での座標と上記平面上での座標とを用いて、カメラ系とスリット光系とを含むセンサパラメータを求めることができる。このセンサパラメータが第3のパラメータに相当する。また、これらは最小2乗法を用いて求めることもできる。このように比較的簡単な構成で第3のパラメータを容易

に求めることができる。その結果,いずれも比較的簡単な構成で,各パラメータを求める際のキャリブレーションデータを比較的短時間に作成することができる。尚,上記第1の実施例に係るキャリブレーション方法ではカメラパラメータを含む第1のパラメータのみを求めているが,この場合は,プロジェクタパラメータである第2のパラメータについては,従来例と同様の方法により求めてもよい。但し,第2の実施例に示すごとく,第2のパラメータを求めた場合には,より短時間にキャリブレーションデータを作成することができる。

[0016]

【発明の効果】本第1の発明に係る3次元計測装置のキャリブレーション方法は、上記したように構成されているため、比較的簡単な装置構成でカメラパラメータを含む第1のパラメータを容易に得ることができる。第2の発明では、比較的簡単な装置構成で上記第1のパラメー

タに加えてプロジェクタパラメータである第2のパラメータをも得ることができる。第3の発明では、比較的簡単な装置構成でカメラパラメータ及びプロジェクタパラメータを含む第3のパラメータを得ることができる。その結果、いずれも比較的簡単な装置構成で、各パラメータを求める際のキャリブレーション用データを比較的短時間に作成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 第1,第2の発明の一実施例(第1,第2の 実施例)に係る3次元計測装置のキャリブレーション方 法の概略構成を示すフロー図。

【図2】 上記第1,第2の実施例に係るキャリブレーション方法を適用可能な装置の概略構成を示す模式図。

【図3】 上記第1,第2の実施例に係るキャリブレー ションターゲットを示す例図。

【図4】 上記第1,第2の実施例に係るキャリブレーション方法の基本原理を示す説明図。

【図5】 第3の発明の一実施例(第3の実施例)に係る3次元計測装置のキャリブレーション方法の概略構成を示すフロー図。

【図6】 上記第3の実施例に係るキャリブレーション 方法の詳細フロー図。

【図7】 上記第3の実施例に係るキャリブレーション ターゲット平面を示す例図。

【図8】 上記第3の実施例に係るキャリブレーション 方法の基本原理を示す説明図。

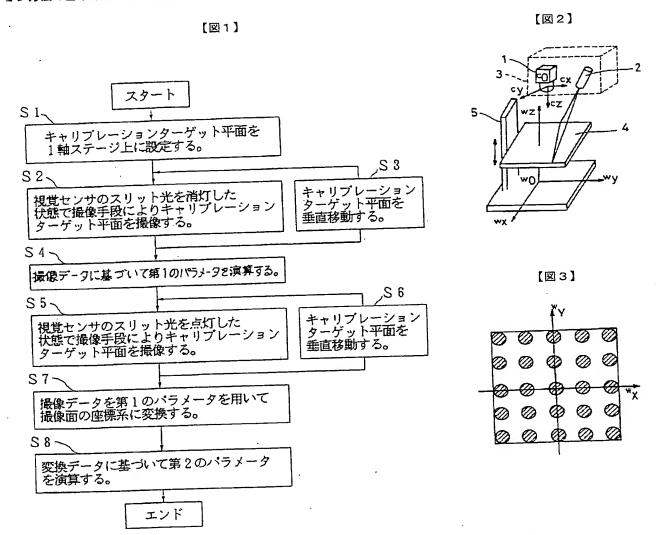
【図9】 従来の3次元計測装置のキャリブレーション 方法を適用可能な装置の一例における概略構成を示す模 式図。

【符号の説明】

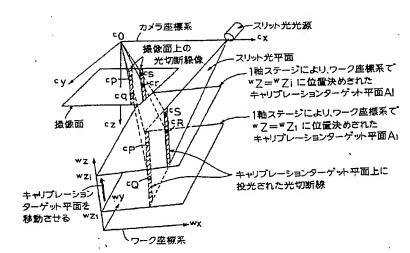
1 …撮像装置(撮像手段に相当)

2…スリット光源(光源に相当)

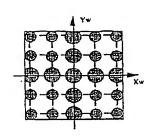
4…キャリブレーションターゲット平面(平面に相当)



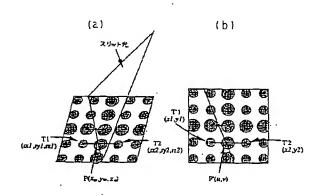
【図4】

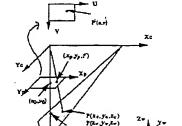


【図7】



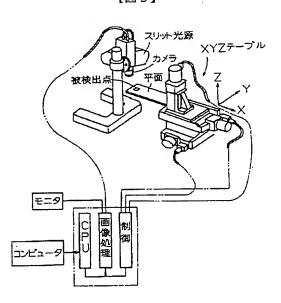
【図8】



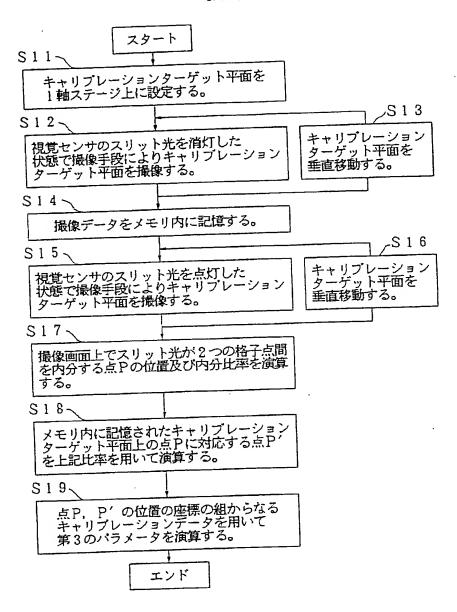


(C)

【図9】



【図5】



【図6】

